



FESTO

マスフローコントローラ VEFC



Highlights

- 幅わずか24mmで非常にコンパクト
- 不活性ガスをダイナミックかつダイレクトに制御するピエゾバルブを採用
- カスタマイズ可能な制御パラメータによってフレキシブル
- デジタル化された指定流量は外乱変数であっても安定
- 優れたコストパフォーマンス

非常にコンパクトでピエゾバルブの利点を全て兼ね備える不活性ガス向けのVEFC：最高度の動的応答性、無限の精度、超低消費電力で発熱なし、手動調整不要の安定した流量
これらすべてに優れた価格/性能比

超コンパクト
市場最小級のサイズ(W24 x L109 x H92mm)でありながら200 l/minの流量を誇るマスフローコントローラ
100 l/minといった追加バージョンも準備中

全てが制御下に
VEFCはデジタル化された製品です。これが手動での調整をしなくても流量を一定に保ちます。流量の調整とその設定に要する時間はわずか数ミリ秒で、かつ改ざんも防止します。

こうしてお客様の製造プロセスにおける最高度のフレキシビリティをもたらします。
VEFCは流量と出力圧を同時に提供するため、プロセスを連続的に監視することができます。

半導体産業にうれしい選択肢
窒素などの不活性ガスのマスフローは、特に半導体産業においてはウェハの不良を回避させるために正確に制御されなければなりません。
VEFCはメディア分離のない不活性ガスに重点を置いており、出力ポー

トやEFEM内の窒素の制御に最適です。しかも価格に関しても他に類を見ないほど魅力的なものとなっています。

VEFCをオンラインで確認

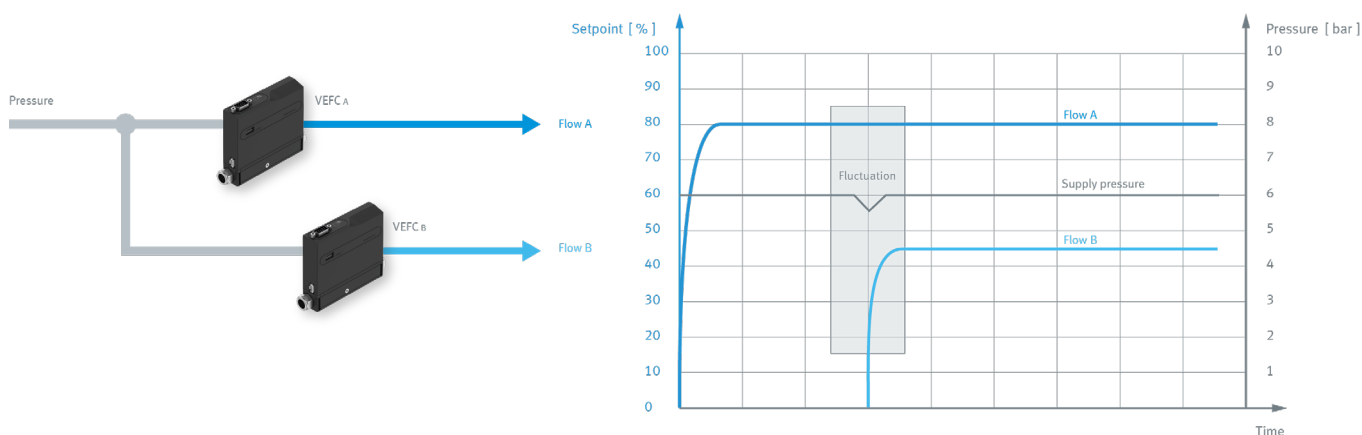




差圧方式の採用

マスフローコントローラ VEFCは差圧方式で稼働します。ピエゾテクノロジーを採用することで流量は圧力変動に対して素早くダイナミックかつ、そ

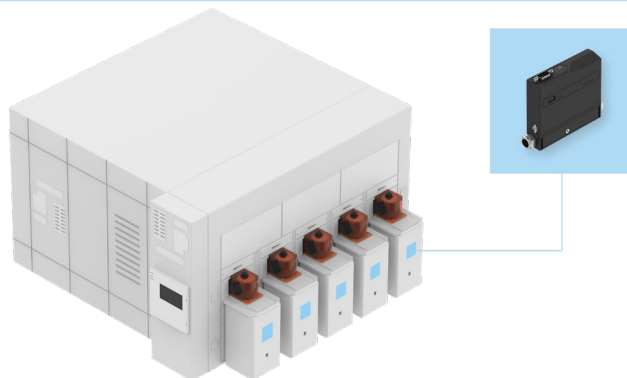
れに反応することなく制御することが可能になります。



経済的、確実に高精度なN₂パージ

ロードポートにVEFCを使用することで、それぞれのパージステップで様々なフローを制御することが可能になります。これにより、プレブロー、プレパージ、プロセスパージ、ポストパージのいずれの場合でも、絶対に必要な量の窒素のみが使用されるようになります。

こうすることで乾燥シールディングガスの雰囲気中に到達するまでの窒素をセーブし、処理時間を短縮させることができますようになります。



テクニカルデータ

VEFC

流体	圧縮空気(7.4.4)/CDA, 不活性ガス(N ₂ , Ar他)
スタンダード条件	DIN 1343; SEMI E12 – N ₂ 相当
流量	200 slm(差圧0.3MPa時)
1次側圧力	0.6MPa
流量精度	±2.5% FS
繰返し精度	±0.75% FS
応答時間	< 100ms
電気接続	アナログ, RS485
パルプテクノロジー	ピエゾテクノロジー
測定原理	差圧
エア接続ポート	Rc1/4, G1/4, QS, 雄ねじ(メタルシール)
作動電圧	24V
保護等級	IP20